

Programma INFN Docenti 24-25 ottobre 2023 Fisica dei materiali

Campostrini Matteo, Rigato Valentino,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali di Legnaro



Dove siamo?

Acceleratore CN: Van De Graaf single end Energia: 0.8 ÷ 12 MeV Fasciionici : H⁺, D⁺, ⁴He⁺, ⁴He⁺⁺, ³He⁺⁺ Beam lines: 7





Dove siamo?

Acceleratore CN: Van De Graaf single end Energia: 0.8 ÷ 12 MeV Fasciionici : H⁺, D⁺, ⁴He⁺, ⁴He⁺⁺, ³He⁺⁺ Beam lines: 7



ENERGIA E CAMPI DI APPLICAZIONE DI FASCI IONICI

IONI PESANTI IONI PESANTI **IONI LEGGERI** C, N - B,P, As.... Protoni, He Ar, Xe,Kr, Metalli 1keV 1MeV 500keV 10MeV 1eV 1000eV

Sintesi di nuovi materiali Trattamenti superficiali Plasmi a bassa pressione Impiantazione ionica Drogaggio di semiconduttori

Microanalisi di materiali (RBS, PIXE, PIGE, ERD, NRA) Microfabbricazione



Attività con fasci ionici al CN

- 1. Irraggiamenti di dispositivi ottici (test accelerati)
- 2. Irraggiamenti di dispositivi elettronici (SEE e endurance test)
- 3. Produzione di fasci di neutroni
 - > Esperimenti di fisica nucleare
 - > Irraggiamento di dispositivi (microdomintria e test su componenti elettronici)

4. Sviluppo e caratterizzazione di materiali avanzati

- > Rivestimenti protettivi e funzionalizzazione superficiali
- ≻ Beni culturali
- > Target per fisica medica
- > Target per fisica nucleare e astrofisica

Irraggiamenti di dispositivi ottici (test accelerati)





Top layer: low absorptivity of sunlight (transparent), high emissivity of infrared radiation.

Back reflector: high reflectivity of sunlight Test accelerati su componenti ottici di satelliti geostazionari. Simuliamo l'irraggiamento naturale di flussi di ioni spaziali. L'irraggiamento di qualche ora con fasci ionici corrisponde a 10-15 anni di attività nello spazio

Degradation effect from UV+Proton Irradiation



8

Irraggiamenti di dispositivi ottici (test accelerati)



Facility installed at -15° CN beam line:

- 1) Ion beam collimators with electron suppressors
- 2) X/Y scanning electrodes
- 3) High voltage fast amplifiers
- 4) Drift tube
- 5) Irradiation chamber with sample holder

Irraggiamenti di dispositivi elettronici e detector

SEE - Single Event Effects

- Effect due to the passage of a **single** energetic ionizing particle
- Sudden large $\Delta E_{ionization}$ deposited in the "wrong" place at the "wrong" time (sensitive junction)

DDD - Displacement (Bulk) Damage Dose

- Non-ionizing ∆E transfers to atomic nuclei (Coulomb nuclear interactions).
- Accumulation of displacement damage of lattice

Endurance test

• Evaluation of life time of the device under ion beam or neutron irradiation



Irraggiamenti di dispositivi elettronici e detector

3D NAND Flash array with vertical-channel architecture

Word line

Increasing

∆V_{th}[a.u.]

Increasing ∆V_{th} [a.u.]

Nickel 30^e

Bit line #

Bit line #

1/E spectrum

Neutrons

Increasing

∆V_{th} [a.u.]

Nickel 0°

Bit line #

Silicon 30^e

Increasing ∆V_{th} [a.u.]

Bit line #

Nord line

Nord line



Dopant coating on HPGe Crystal Next generation of γ- detector





Dosimeter for medical application



Produzione di fasci di neutroni

Il fascio di neutroni viene prodotto utilizzando fasci di protoni e deutoni su target di Berilio e Litio

Viene utilizzato principalmente per irraggiamenti di dispositive elettronici, dosimetri o per studi di fisica nucleare





Studio di beni culturali





µPIXE analysis



Studio della composizione con particolare attenzione dei contaminanti in traccia di reperti storici per determinare la provenienza, mediante tecnica PIXE Attivita presso AN2000

Fisica Nucleare in Medicina

- Sviluppa nuovi materiali per diagnostica, analisi e terapia in campo della medicina nucleare
- Ottimizza la produzione di nuovi radionuclidi mediante reazioni nucleari tra materiale target e fascio ionico utilizzando acceleratori di particelle



Tecniche diagnostiche funzionali PET e SPECT

Fisica Nucleare in Medicina: Caratterizzazione

15 20 25 30 35 40 45

Energy (MeV)



Attività PID, Liliana Mou

3) Studio della Nuclear cross section 48Ti(p,2p)47Sc Gadioli (1981) Levkovski* (1991) This work ----- TALYS . H I i i

50

2) Caratterizzazione



OBBIETTIVO Trovare le migliori condizioni di irraggiamento per massimizare la produzione di radiofarmaci

Sviluppo e caratterizzazione di materiali avanzati

Synthesis and Process Development



- Low Friction, High Hardness Nanoscaled Materials and Multilayers
- Insulating Oxides

٠

• High Performance





Plasma Sputtering

Plasma Diagnostics

Ion-solid interaction

Deposition

Characterization of Physical Properties



- Ion Beam Analysis (RBS, NRA, ERDA, PIXE)
- Microbeam (Micro-PIXE 2-D trace element analysis)





Morphology, Mechanical prop.

- Nano Hardness, Elastic modulus
- Adhesion (Micro-Scratch)
- Intrisic Stress
- Atomic Force Microscopy & SEM

Sviluppo e caratterizzazione di materiali avanzati

Funzionalizzazione superficiale: è la modifica delle proprietà superficiali di un materiale, per ottenere caratteristiche differenti dal materiale massivo di partenza.



Filtri ottici per applicazioni fotovoltaiche (università di Trento)



Rivestimenti di rinforzo per applicazioni Meccaniche in component da vuoto (Aziende del settore)



Realizzazione di component elttronici ultracompatti (Aziende del settore)



Sviluppo di materiali per esperimenti di fisica nucleare: Esempi di Target



PID 202.

Sviluppo di materiali per esperimenti di fisica nucleare: Tecniche di caratterizzazione

Morfologiche:

- SEM (scanning electron microscope)
- AFM (atomic force microprobe)



Composizionali:

• IBA (ion beam analysis) tecniche nucleari non distruttive

DA COSA sono fatti i nostril bersagli

Sviluppo di materiali per esperimenti di fisica nucleare: Tecniche di caratterizzazione

Morfologiche:

• SEM (scanning electron microscope)





Spessore 120nm



Sviluppo di materiali per esperimenti di fisica nucleare: Tecniche di caratterizzazione NON DISTRUTTIVE SAMPLE



- PIXE (proton induced X ray emission)→ misura dei raggi X emessi → analisi degli elementi
- PIGE (particle induced γ ray emission) → misura dei raggi gamma emessi → analisi di alcuni isotopi leggeri
- EBS (elastic backscattering spectrometry)→ misura delle particelle del fascio "rimbalzate" all'indietro → analisi composizionale e strutturale
- IBIL (ion beam induce luminescence)→ misura della radiazione luminosa ultravioletta e visibile → analisi di alcuni legami molecolari
- NRA (nuclear reaction analysis)→ misura delle particelle prodotte nelle interazioni nucleari → analisi di isotopi

CENNI TEORICI RUTHERFORD BACK SCATTERING: fattore cinematico K

KINEMATICS OF ELASTIC COLLISION



Schematic representation of an elastic collision between a projectile of mass M_1 and energy E_0 and a target mass M_2 which is initially at rest. After the collision, the projectile and target mass have energies E_1 and E_2 respectively. The angles θ and ϕ are positive as shown.

All quantities refer to a laboratory frame of reference.

For $M_1 < M_2$, conservation of energy and momentum, gives:

$$\frac{E_1}{E_0} = \left[\frac{(M_2^2 - M_1^2 \sin^2\theta)^{1/2} + M_1 \cos\theta}{M_1 + M_2}\right]^2$$
$$E_1 = K_{M_2} E_0$$

 K_{M_2} = kinematic factor

CENNI TEORICI RUTHERFORD BACK SCATTERING: Sezione d'urto

ELASTIC SCATTERING CROSS SECTION

For the <u>COULOMB INTERACTION</u>, a central force field, the differential scattering cross section of a target atom for scattering an incident particle through an angle θ into a differential solid angle d Ω centered about θ , in the laboratory frame of reference is given by:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{2E \sin^2 \theta}\right)^2 \frac{[\cos\theta + (1 - \mu^2 \sin^2 \theta)^{1/2}]^2}{(1 - \mu^2 \sin^2 \theta)^{1/2}}$$

 $\mu = M_1/M_2$

E = energy of the projectile immediately before scattering In backscattering spectrometry, the detector solid angle Ω is small (about 10⁻³ steradians) so that one defines an average differential scattering cross section:

$$\sigma(\mathsf{E}, \theta) = (1/\Omega) \int_{\Omega} (\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega) \mathrm{d}\Omega$$

25

CENNI TEORICI RUTHERFORD BACK SCATTERING:

Calcolo della dose [atm/cm²]

and the scattering angle θ is well defined. It is then convenient[†] to introduce the *average differential scattering cross section* σ :

$$\sigma \equiv (1/\Omega) \int_{\Omega} (d\sigma/d\Omega) \, d\Omega. \tag{2.18}$$

For very small detector angles Ω , $\sigma \rightarrow d\sigma/d\Omega$. The average differential scattering cross section is the value ordinarily used in backscattering spectrometry. It is usually called *scattering cross section* in the literature. We follow this convention.

For the experimental condition given in Fig. 2.4, in which a uniform beam impinges at normal incidence on a uniform target that is larger than the area of the beam, the total number of aetected particles of sen be written from Economic (2.18) as

$$A = \sigma \Omega \cdot Q \cdot Nt.$$

(2.19)

 $\begin{pmatrix} \text{number of} \\ \text{detected particles} \end{pmatrix} = \sigma \Omega \cdot \begin{pmatrix} \text{total number of} \\ \text{incident particles} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \text{number of target} \\ \text{atoms per unit area} \end{pmatrix}.$

This equation shows that when σ and Ω are known and the numbers of incident and detected particles are counted, the number of atoms per unit area in the target, Nt, can be determined. The ability of backscattering spectrometry to provide quantitative information on the number of atoms present per unit area of a sample stems from Eq. (2.19) and the fact that the average scattering cross section σ of the elements is known quite accurately.

CENNI TEORICI RUTHERFORD BACK SCATTERING: Straggling e perdita di energia non elastica

2.6 ENERGY STRAGGLING

An energetic particle that moves through a medium loses energy via many individual encounters. Such a quantized process is subject to statistical fluctuations. As a result, identical energetic particles, which all have the same initial velocity, do not have exactly the same energy after passing through a thickness Δx of a homogeneous medium. The energy loss ΔE is subject to fluctuations. The phenomenon, sketched in Fig. 2.10, is called energy straggling. Energy straggling places a finite limit for the precision with which energy losses, and hence depths can be resolved by backscattering spectrometry. The ability to identify masses is also impaired, except for atoms located at the surface of the target. The reason is that the beam energy E before a collision with a specific mass M_2 at some depth within the target is no more monoenergetic, even if it was so initially, so that the ratio E_1/E_0 , and hence the identification of M_2 , become uncertain as well. For these reasons, it is important to have quantitative information on the magnitude of energy straggling for any given combination of energy, target material, target thickness, and projectile.





CENNI TEORICI RUTHERFORD BACK SCATTERING: Straggling e perdita di energia non elastica

Δx

Thin target 33

Incident

particles

2.4 Energy Loss and Stopping Cross Section

Fig. 2.6 Schematic of a transmission experiment to measure the $\Delta E/\Delta x$ loss of a swift particle in a dense medium.

the target, it slows down and its kinetic energy $E = \frac{1}{2}M_1v^2$ decreases. The amount of energy ΔE lost per distance Δx traversed depends on the identity of the projectile, on the density and composition of the target, and on the velocity itself. The simplest experiment that can be conceived to determine this energy loss is to take a very thin target of thickness Δx and of known composition. A beam of monoenergetic particles is directed at this target (see Fig. 2.6). The energy difference ΔE of the particles before and after transmission through the target is measured. The *energy loss* per unit length, also called sometimes the *specific energy loss*, and frequently abbreviated dE/dx loss, at the energy E of the incident beam is then defined as

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta E / \Delta x \equiv \frac{dE}{dx}(E)$$
(2.25)

E-AE

Transmitted

particles

for that particular particle and energy in that medium. Note that this expression gives an energy loss that is a positive quantity.

3.5 Spectrum Height—Elemental Sample







Fig. 3.13 Schematics of and nomenclature for (a) the backscattering process at depth x_i within a monoisotopic sample in the language of discrete functions, and (b) the resulting spectrum. (c) and (d) give the corresponding schematics and nomenclature in the language of continuous functions.

28

73

ALITVITA SPENIMENTAL

Strumentazione per generazione segnale: Detector e relativa geometria di scattering



Ion beam: He⁺ Energy: 3.1MeV θ=170°

Strumentazione per acquisizione segnale: catena

elettronica



Segnale dal detector



Figure 1. Comparison of sample input and output pulse shapes

Segnale dal shaping amplifier

Simplified illustration of the equipment used for RBS.

Strumentazione per acquisizione segnale: esempio di spettro di film sottile



For a thin target of thickness t with N atoms/cm³, the <u>YIELD</u>, or the number of detected particles in a detector that subtend a solid angle Ω is:

 $Y = \sigma(E,\theta)\Omega QNt^{-1}$

Q = total number of incident particles in the beam

Peak areas scale with N and (in first approximation) with Z_2^2 .

Absolute coverages of a heavy element on a light substrate can be detected down to a limit of about 10⁻³ monolayers.

Analisi campione noto di SiO2 depositato su substrato di Si Obiettivi:

- 1. Valutare il differente fattore cinematico tra elementi con massa diversa
- 2. Valutare lo stopping power
- 3. Osservare l'effetto tra spettro simulato basato su formule teoriche (RBS teorico) e spettro acquisito con risonanza (EBS reale)
- 4. Valutare divesa sezione d'urto tra elementi con Z diverso



Analisi campione noto di SiO2 depositato su substrato di Si Obiettivi:

• Valutare il differente fattore cinematico tra elementi con massa diversa



Analisi campione noto di SiO2 depositato su substrato di Si Obiettivi:

• Valutare lo stopping power



 ΔE è dovuto alla perdita di energia dello ione che attraversa il materiale del primo layer (SiO_2) Il ΔE dipende dallo "stopping power" del materiale e quindi dal "rallentamento" (interazione non elestica) dello ione che interagisce con il "materiale attraversato".

Analisi campione noto di SiO2 depositato su substrato di Si Obiettivi:

• Valutare divesa sezione d'urto tra elementi con Z diverso



Analisi campione noto di SiO2 depositato su substrato di Si Obiettivi:

• Valutare divesa sezione d'urto tra elementi con Z diverso



Analisi campione noto di SiO2 depositato su substrato di Si Obiettivi:

Osservare l'effetto tra spettro simulato basato su formule teoriche (RBS teorico) e spettro acquisito con risonanza (EBS reale)



Analisi campione noto di SiO2 depositato su substrato di Si Obiettivi:

Osservare l'effetto tra spettro simulato basato su formule teoriche (RBS teorico) e spettro acquisito con risonanza (EBS reale)



CONCLUSIONI

- I fasci ionici sono utilizzati in svariati campi, sia di ricerca che di sviluppo tecnologico
- Le tecniche Ion Beam Analysis sono uno strumento di caratterizzazione indispensabile in diversi settori per lo studio di materiali
- È stato descritto e mostrato un tipico setup sperimentale per la caratterizzazione EBS
- È stato acquisito uno spettro EBS su SiO₂/Si con un fascio di He+ di energia 3.1 MeV
- Lo spettro è stato selezionato per motivi didattici in quanto mostra una risonanza e quindi una discrepanza della sezione d'urto teorica a 3.05MeV [${}^{16}O(\alpha,\alpha){}^{16}O$]

Per qualsiasi informazione o approfondimento matteo.campostrini@lnl.infn.it